

Wszystkie zaplanowane egzaminy
w JESIENNEJ sesji ze względu
na COVID-19 będą odbywać się
w formie zdalnej.

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2019/2020

STUDIA DZIENNE

Studia II stopnia – rok I

Grupa Data	MTMX-221	IB000-211	MT000-211			IPAUT-221	IPIPМ-221	IРROB-221
01.09		PSB (sem. I) godz. 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	SMC godz. 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰			PSA (sem. II) godz. 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰	ZTS (sem. I) godz. 9 ¹⁵	ZTS (sem. I) godz. 9 ¹⁵
02.09	MCS (sem. II) 9 ¹⁵ - 12 ¹⁵	ZTPDM godz. 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰						
03.09		WDM (sem. I) godz. 11 ¹⁵	MEN (sem. I) godz. 11 ¹⁵ – 14 ⁰⁰					
04.09	INOP (sem. I) 8 ¹⁵ - 11 ¹⁵	TELM godz. 9 ¹⁵					ZTPR (sem. I) godz. 9 ¹⁵	
05.09								
06.09								
07.09	IPR (sem. I) 9 ¹⁵ - 12 ¹⁵		PMO (sem. I) godz. 12 ¹⁵					NNSI (I – termin) godz. 9 ¹⁵
08.09	DAFO (sem. I) 9 ¹⁵ - 12 ¹⁵		OFD (sem. I) godz. 12 ¹⁵			IUD (sem. II) godz. 9 ¹⁵	ZPIN (sem. VI) godz. 12 ¹⁵	
09.09	MTD godz. 11 ¹⁵ - 14 ⁰⁰							
10.09	MOP (sem. I) 9 ¹⁵ - 12 ¹⁵							
11.09	OMS (sem. II) 9 ¹⁵ - 12 ¹⁵	RDTR (sem. I) godz. 12 ¹⁵	SMM godz. 12 ¹⁵ – 15 ⁰⁰			TES (sem. I) godz. 9 ¹⁵	SBI (sem. I) godz. 9 ¹⁵	SNER (sem. I) godz. 8 ¹⁵
12.09								
13.09								
14.09	OFFM (sem. II) 9 ¹⁵ - 12 ¹⁵							
15.09								

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2019/2020

STUDIA DZIENNE

Studia II stopnia – rok II

Grupa	MTMX-231	MTESP-231
Data		
02.09		
01.09		
02.09		
03.09		
04.09		
05.09		
06.09		
07.09		
08.09		
09.09	NMOT (sem. III) 12 ¹⁵ - 15 ¹⁵	
10.09		
11.09		
12.09		
13.09		
14.09		NNMT (sem. III) godz. 9 ¹⁵
15.09		

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2019/2020

STUDIA DZIENNE

Objaśnienia użytych skrótów:

AAG	- Algebra and Geometry	OMS	- Optical microsystems
ABI	- Aparatura biomechaniczna	ONMP	- Opto-numeryczne metody pomiaru
AKE	- Aktuatoryka elektryczna	ONMT	- Opto-numerical Methods and Testing
AKU	- Podstawy akustyki i elektroakustyki	OPTM	- Optomechatronics
ANAL2	- Analiza 2	PA	- Podstawy automatyki
AUJ	- Audyty jakości	PMO	- Podstawy mikroskopii optycznej
AUP	- Automatyka przemysłowa	POMED	- Podstawy obrazowania medycznego
BEM	- Budowa i eksploatacja urządzeń mechatroniki	PPO	- Polowe pomiary optyczne
BMINZ	- Biomechanika inżynierska	PRD	- Podstawy realizacji dźwięku
BOAC	- Basis of Automation and Control I	PSA	- Projektowanie systemów automatyki
CALC1	- Calculus I	PSB	- Przetwarzanie sygnałów biomedycznych
CALC2	- Calculus II	PSBD	- Podstawy systemów baz danych
CALC3	- Calculus III	PSF	- Projektowanie systemów funkcjonalnych
DAFO	- Diffraction and Fourier Optics	PTB	- Podstawy technik badań urządzeń precyzyjnych
DPP	- Diagnostyka procesów przemysłowych	PTM	- Podstawy teorii mechanizmów
DTP	- Podstawy poligrafii i projektowania DTP	PTS	- Przetwarzanie sygnałów
EAMEB	- Elektroniczna aparatura medyczna	PW1-TSIS	- Przedmiot wariantowy 1 - "Technika światłowodowa i sensory"
ELCR	- Electric Circuits	RDTR	- Radioterapia
ELCS1	- Electronics 1	ROB	- Robotyka
ELE1	- Elektronika 1	SAP	- Systemy automatyzacji produkcji
ELM	- Elementy i zespoły mechatroniczne	SAU	- Systemy automatyki
ENPH	- Engineering Physics	SBI	- Systemy Business Intelligence
EUM	- Eksploatacja urządzeń mechatronicznych	SEPO	- Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych
FI2	- Fizyka 2	SIRDM	- Standardy i rejestracja danych multimedialnych
FIB	- Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej	SIWP	- Systemy informatyczne w przemyśle
FIZ	- Fizyka	SMC	- Systemy mechatroniczne
FLM1	- Fluid mechanics I	SMM	- Systemy mikroprocesorowe w mechatronice
FMD2	- Fine Machine Design II	SMPM	- Systemy pomiarowe
FOP	- Fundamentals of Photonics	SMPW	- Skaningowe metody pomiarów współrzędnościowych
FOT	- Podstawy fotoniki	SNER	- Serwonapędy elektryczne robotów
IAP	- Inteligentna aparatura pomiarowa	SOR	- Sterowanie i programowanie robotów
INOP	- Instrumental optics	SPC	- Sterowanie procesów ciągłych
INOP	- Instrumental optics	SPD	- Sterowanie procesami dyskretnymi
IPR	- Image Processing and Recognition	SPWT	- Sensory i przetworniki wielkości termodynamicznych
IPR	- Inżynieria oprogramowania	STM	- Sensory w technikach multimedialnych
IUD	- Identyfikacja układów dynamicznych	STUT	- Sterowanie urządzeń technologicznych
KMG	- Komputerowe modelowanie geometryczne	TEL	- Technika laserowa
LTC	- Laser Techniques	TELM	- Systemy telemedyczne
MCN	- Mechanics	TES	- Teoria sterowania
MCS	- Mechatronic Systems	TEW	- Technika wizyjna
MEL	- Materiały elektroniczne	TINF	- Transmisja informacji
MEN	- Matematyka - Metody numeryczne	TLB	- Techniki laboratoryjne i badawcze
MEN	- Metody numeryczne	TOE	- Technologia obwodów elektronicznych
MEP	- Metrologia przemysłowa	TPW	- Teoria Pomiarów Współrzędnościowych
MiNE	- Mikro- i nanoukłady elektroniczne	TTV1	- Technika telewizyjna 1
MNT	- Mikro/nanotechnika	UAP	- Urządzenia automatyzacji produkcji
MOP	- Medical Optics	UIZE	- Układy i zespoły elektroniczne
MOS2	- Mechanics of Structures II	UMD1	- Urządzenia multimedialne - I
MPR	- Metodyka projektowania urządzeń mechatronicznych	UPSK	- Urządzenia peryferyjne systemów komputerowych
MRP	- Maszyny i roboty pomiarowe	WDM	- Wybrane działy matematyki
MSI	- Metody sztucznej inteligencji	WELE	- Wstęp do elektrotechniki
MSWBP	- Metody statystyczne w badaniach przemysłowych	ZBR	- Zasady budowy robotów
MSYP	- Modelowanie systemów pomiarowych	ZPIN	- Zarządzanie projektem informatycznym
MTD	- Matematyka dyskretna	ZSDO	- Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych
MTL	- Programowanie w systemie MatLab	ZSDO	- Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych
MTLG	- Metrology	ZTP	- Zaawansowane techniki programowania
MWM	- Mechanika i wytrzymałość materiałów	ZTPDM	- Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych
NM1	- Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki I	ZTPTP	- Zaawansowane techniki pomiarowe w topografii powierzchni
NMOT	- Numerical Methods in Optical Techniques	ZTS	- Zaawansowane techniki sterowania
NNMT	- Nanometrologia / Nanometrology	ZPIN	- Zarządzanie projektem informatycznym
NNSI	- Nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji w robotyce mobilnej	NEM	- Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych
OFD	- Optyka fourierowska i dyfrakcyjna		
OFD	- Optyka fourierowska i dyfrakcyjna		
OFFM	- Optical full-field measurement		
OFT	- Optical Fiber Technology		
OI1	- Optyka instrumentalna I		